

<i>Вус А.С.</i> Структура и свойства одно- и двухкомпонентных электропроводящих пленок, сформированных из трансформированных при взаимодействии с проводящей мишенью ионно-плазменных потоков ....	288
<i>Lapshin V.I.</i> Influence of the nonlinear effects on resonance energy absorption and plasma-wall interaction in helical magnetic field .....	312
<i>Выжол Ю.А., Жорова А.Н., Муленко И.А., Хомкин А.Л.</i> Электронные кинетические коэффициенты неидеальной полностью и частично ионизированной плазмы .....	318
<i>Недоля А.В., Пиваев Е.И., Титов И.Н.</i> Температурное распределение на катодном эмиттере при формировании высокочастотной вакуумной дуги .....	330
<i>Хороших В.М., Леонов С.А., Белоус В.А., Толмачева Г.Н.</i> Об особенностях процесса осаждения ионно-плазменных покрытий на основе нитрида титана в области давлений азота $2 \div 10$ Па .....	335
<i>Глазунов Г.П., Андреев А.А., Барон Д.И., Шулаев В.М., Столбовой В.А., Чернышенко В.Я.</i> Влияние способа нанесения вакуумно-дуговых TiN покрытий на их газовыделение в вакууме при высоких температурах .....	341
<i>Недоля А.В., Титов И.Н.</i> Учет отражающей способности осадка тугоплавкого металла, полученного лазерным пиролизом из газовой фазы .....	347
<i>Удовицкий В.Г.</i> Методы оценки чистоты и характеристики свойств углеродных нанотрубок .....	351
<i>Погребняк А.Д., Соболев О.В., Береснев В.М., Турбин П.В., Толмачева Г.Н., Махмудов Н.А., Шипиленко А.П., Каверин М.В., Пишик А.В., Фурсова Е.В.</i> Влияние механизмов сегрегации на смещение границ раздела и стабильность сверхтвердых нанокompозитов Zr-Ti-Si-N .....	374
<i>Дьяченко С.С., Пономаренко И.В., Золотко В.А.</i> Возможности получения наноструктуры в массивных изделиях и влияние наноструктурирования на их свойства .....	386
<i>Пятак Н.И.</i> Собственные колебания в несимметричных волноводных разветвлениях .....	398
<i>Ефимов В.П.</i> Кластерные образования проводящих квантовых структур в монокристаллическом кремнии для гелиоэнергетики .....	402
<i>Персоналии</i> .....	409
<i>Правила оформления рукописей</i> .....	410
<i>Правила оформлення рукописів</i> .....	411
<i>Information for authors</i> .....	412